

## Chemisch Nickel Automat

Diese vollautomatische Produktionsanlage wurde für den Stromlos Nickel Prozess gefertigt und ist für 2" bis 8" Wafer in Carriern geeignet.

Dieser Prozess ist für fast alle Waferarten einsetzbar.

Die Wafer Bumping Anlage kann auf Wunsch auch als manuelle oder halbautomatische Anlage ausgeführt werden.



## Electroless Nickel Bumping Automatic Plant

This fully automatic production plant was manufactured for the electroless nickel bumping (ENB) process and is suitable for 2" to 8" wafers in carriers.

This process can be used for almost any type of wafer.

The wafer bumping plant can also be manufactured as a manual or semi-automated plant.

50 °C  
90 °C

20 °C

RAMGRABER GmbH  
SEMICONDUCTOR EQUIPMENT  
Hofolding, Pappelstrasse 2  
D-85649 Brunnthal

Telefon: 08104 / 6487-0  
Telefax: 08104 / 6487-79  
Telephone: +49 / 8104 / 6487-0  
Telecopier: +49 / 8104 / 6487-79  
[www.ramgraber.de](http://www.ramgraber.de)

## Example: Electroless Nickel Bumping Manual Plant



### Weiteres Lieferprogramm

Hotplate / Belackungsschleuder  
 Wetbenches / Digestorien  
 Einbaukomponenten für Wetbenches / Digestorien  
 Automatisierung  
 Anlagen für Wafer-/Substratbearbeitung  
 Wafer- / Substrat-Handhabung  
 Rinser Dryer / Dryer / Einzelscheibenschleuder  
 Teilereinigung / Quarzteilerreinigung  
 Medienver- / entsorgungsstationen  
 Reinraum- / Laboreinrichtungen  
 Galvanikanlagen  
 Zubehör

### Additional Product Line

Hotplate / Spin Coater  
 Wetbenches / Digestorien  
 Install Components for Wetbenches / Digestorien  
 Automatization  
 Plants for Treatment of Wafer / Substrates  
 Handling of Wafer / Substrates  
 Rinser Dryer / Dryer / Single-Wafer-Centrifugal  
 Parts Cleaning / Quartzparts Cleaning  
 Media Supply / Disposal Stations  
 Cleanroom / Lab Equipment  
 Electroplating Plants  
 Accessories